



(第53期定時株主総会招集ご通知添付書類)

第53期 報告書

平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

株主の皆さまへ



代表取締役社長・CEO
河合 利樹

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

また、平成28年4月に熊本県で発生した地震により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

第53期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）報告書として、事業の概況等をご報告いたします。

IoT時代を迎え、半導体製造装置及びFPD製造装置の需要は益々高まります。このような環境のなか、当社の業界内における強固なポジションをさらに確かなものとするため、平成27年7月に「中期経営計画」を策定いたしました。また、より魅力的な株主還元策として、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向を50%に引き上げております。加えて、当社は平成27年12月に「東京エレクトロン コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しました。このガイドラインに基づき、今後も株主の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダーの皆さまに、より大きな企業価値を提供できるよう努めてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、一層のご支援とご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

平成28年5月

目次

株主の皆さまへ……………	1	計算書類	
(第53期定時株主総会招集ご通知添付書類)		(個別) 貸借対照表 ……………	29
事業報告		(個別) 損益計算書 ……………	30
1. 当社グループの現況に関する事項……………	2	(個別) 株主資本等変動計算書 ……………	31
2. 会社の株式に関する事項……………	13	監査報告書	
3. 会社の新株予約権等に関する事項……………	14	連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 ……	32
4. 会社役員に関する事項……………	15	会計監査人の監査報告書 謄本 ……………	33
5. 会計監査人の状況……………	20	監査役会の監査報告書 謄本 ……………	34
6. 会社の体制及び方針……………	21	(ご参考)	
連結計算書類		特集	
連結貸借対照表……………	25	半導体 (IC) / TFT-LCD製造プロセス ……………	35
連結損益計算書……………	26	株主メモ ……………	37
連結株主資本等変動計算書……………	27		
(ご参考) 連結キャッシュ・フロー計算書……………	28		

「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、当社ウェブサイト (<http://www.tel.co.jp/>) に掲載しておりますので本報告書には記載しておりません。

事業報告 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1. 当社グループの現況に関する事項

1 事業の経過及び成果

当連結会計年度につきましては、中国をはじめとするアジア新興国の景気減速や原油安の影響等により先行きの不透明感が強まりをみせています。一部には弱さがみられるものの、世界経済は総じて緩やかな回復を示しております。

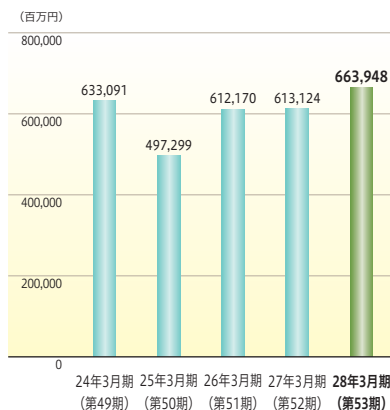
エレクトロニクス産業におきましては、モバイル端末の高性能化に伴う端末1台当たりの半導体搭載量の増加やデータセンター向けサーバー需要が拡大をみせたものの、スマートフォンやパソコン販売の伸び鈍化により需要は力強さを欠き、電子部品市場は伸び悩みました。当社グループの参画しております半導体製造装置市場は、期後半より半導体メーカーによる先端投資が回復を示

し、総じて堅調に推移しております。

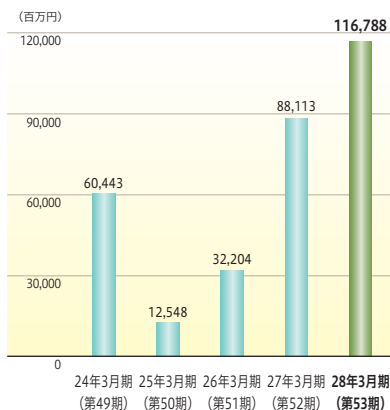
このような状況のもと、当連結会計年度の業績は、売上高は6,639億4千8百万円(前連結会計年度比8.3%増)、営業利益は1,167億8千8百万円(前連結会計年度比32.5%増)、経常利益は1,193億9千9百万円(前連結会計年度比28.5%増)となりました。特別損益に関しましては、TELFSL, Inc.の事業計画を見直したことによる固定資産の減損等を計上した結果、129億3千2百万円の損失(前連結会計年度は61億2千1百万円の損失)となり、親会社株主に帰属する当期純利益は778億9千1百万円(前連結会計年度比8.4%増)となりました。

■ 連結業績推移

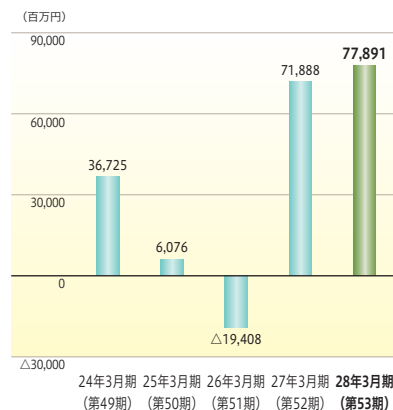
売上高



営業利益



親会社株主に帰属する当期純利益



(注) △は損失を示しております。

2 主要な事業内容及びセグメント別の概況

当社グループは、エレクトロニクス技術を利用した半導体製造装置及びFPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置の製造・販売を事業の中心としております。

半導体製造装置

■ 事業の状況

スマートフォン等の高機能化に伴う端末1台当たりの半導体搭載量の増加や、ビッグデータ活用の拡がりを受けて伸長するデータセンター向けサーバー需要を背景に、DRAM及びNANDフラッシュメモリー需要は底堅く推移しました。このような市場環境のなか、メモリーメーカーにおいて増産を主な目的とした投資が進められました。また、ロジック系半導体に関しても、旺盛なサーバー需要により先端技術に対する設備投資等が続いております。この結果、当セグメントの当連結会計年度の外部顧客に対する売上高は、6,130億3千2百万円（前連結会計年度比6.4%増）となりました。

なお、当セグメントにおきましては、当連結会計年度に先端パッケージング技術対応塗布現像装置「CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ AP」、先端パッケージング向け高効率めっき装置「Stratus™ P300」、高温プロセスによる微細化対応枚葉成膜装置「Triase+™ EX-II™ TiN Plus HT」などの新製品をリリースしました。

■ 新製品

コータ/デベロッパ
CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ AP



枚葉CVD装置
Triase+™ EX-II™ TiN Plus HT



■ 主要営業品目

- コータ/デベロッパ
- 枚葉成膜装置
- プラズマエッチング装置
- 洗浄装置
- 熱処理成膜装置
- ウェーハブローバ

プラズマエッチング装置
Tactras™



ALD装置
NT333™



枚葉洗浄装置
CELLESTA™-i



ウェーハブローバ
Precio™ XL



FPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置

■ 事業の状況

中国における大型液晶パネル向け設備投資に加え、モバイル端末向けの中小型液晶パネル需要も伸長し、FPD製造装置市場は堅調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当連結会計年度の外部顧客に対する売上高は、446億8千7百万円（前連結会計年度比36.6%増）となりました。

また、当セグメントにおきましては、当連結会計年度に高精細フラットパネルディスプレイ向けドライエッチング装置「Impressio™1800 PICP™」を市場に投入いたしました。

■ 主要営業品目

- FPDプラズマエッチング/アッシング装置
- FPDコータ/デベロッパ

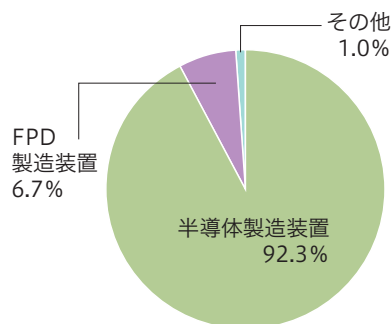
FPDプラズマエッチング/アッシング装置
Impressio™



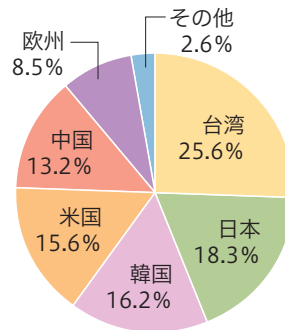
■ その他

上記2セグメントに含まれない事業における当連結会計年度の外部顧客に対する売上高は、62億2千8百万円（前連結会計年度比49.3%増）となりました。

■ 連結 セグメント別売上構成比



■ 連結 地域別売上構成比



(注) 当連結会計年度から、事業撤退を発表しております「PV（太陽光パネル）製造装置」事業につきましては、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、報告セグメントから除外し、「その他」の区分に含めて記載する方法に変更しております。前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

3 設備投資及び資金調達の状況

当社グループの当連結会計年度に取得した有形固定資産は133億4千1百万円となりました。中期経営計画の目標達成に向け、顧客のニーズに基づく開発を進めるため、半導体製造装置事業の高成長が期待できる重点開発分野を中心に、評価用機械装置や研究開発用機械装置等の設備投資を実施いたしました。

なお、必要資金については全額を自己資金で賄い、資金調達は実施しませんでした。

4 対処すべき課題

当社グループは、「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念のもと、技術革新の激しいエレクトロニクス産業のなかで、半導体及びFPD製造装置のリーディングサプライヤーとして、ビジネスを積極的に展開しております。

① 長期的な経営方針

当社グループは、技術専門商社からスタートし、開発製造機能を持つメーカーへの移行、グローバルな販売・サポート体制の構築など、環境の変化をいち早く捉え、大胆に自らを変えて適応していくことにより、世界の市場に高い付加価値を提供してまいりました。また、当社は、半導体製造装置やその関連分野など、技術革新が新たな価値を生み、かつ高収益を期待できる事業分野において、独創的な技術で時代をリードすることにより成長を続けてきました。

当社の原動力は、創立時から継承されている徹底した顧客第一主義、技術革新を実現できる高い技術力、そして環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる社員のチャレンジ精神です。

今後も技術革新による価値創出が見込まれる既存の事業分野を含め、エレクトロニクス技術を基盤とした成長分野において、当社で培った最先端技術を応用して事業創出に取り組み、ワールドクラスの高収益企業を目指してまいります。

② 中期経営計画

当社は、産業界と社会への貢献を通じ、利益を得て、企業価値を向上させることにより、「当社を信頼して投資していただいた株主の皆さまへの還元」と「社員とその家族を豊かにすること」ができると考えております。そのための具体的な成果目標として、当社は平成27年7月10日に、平成32年3月期までの中期経営計画を公表いたしました。

中期ビジョン

革新的な技術力と、多様なテクノロジーを融合する独創的な提案力で、半導体産業とFPD産業に高い付加価値と利益を生み出す真のグローバルカンパニー

ファイナンシャルモデル

半導体前工程製造装置の市場規模370億米ドルを前提とする、新たなファイナンシャルモデルを設定し、平成32年3月期までに達成することを目標としています。

半導体前工程製造装置市場規模	370億米ドル
売上高	9,000億円
営業利益率	25%
ROE（自己資本利益率）	20%

なお、半導体業界特有の景気循環変動の大きい市場特性に鑑み、仮に市場規模を300億米ドルとした場合においても、売上高7,200億円、営業利益率20%、ROE15%を達成できる経営体質を築いてまいります。

中期経営計画実現のための課題

IoT時代を近未来に迎え、半導体の需要は今後益々高まると考えられます。他方、半導体の微細化は10ナノメートル以下の領域に入ろうとしておりますが、これは原子を数十個並べた程度の大きさに相当し、まさに究極の微細加工領域への挑戦を意味します。半導体技術は変換点を迎えていると言われておりますが、半導体デバイスの性能向上への要求は止まりません。これからも当社グループは、更なる微細加工技術を追求するとともに、新構造や新材料技術の導入、新たなパッケージ技術などの研究開発を同時進行的に進めます。顧客の技術要求水準が高くなることは、多様な技術を保有する当社グループにとって、事業拡大のチャンスです。今後益々、製造装置メーカーとしての当社の総合力が必要とされる時代になっていくことから、当社グループの持てる力を結集し、顧客に対して革新的なソリューションを提案できる技術集団として、業界を牽引していきたいと考えております。

このような状況のもと、新生東京エレクトロンは、半導体製造装置事業及びFPD製造装置事業に集中し、次に掲げる3つの強化項目に取り組んでおります。

3つの強化項目

- ・製品競争力強化
- ・顧客対応力強化
- ・利益体質強化

顧客の最先端技術ニーズに応えるためには、強い次世

代製品を継続的に創出することが肝要と考えております。製品ごとに構成するビジネスユニットを軸にしていた開発部隊を、開発・生産本部長の元に集約、一元化することにより、個々の工場、ビジネスユニットが持つ多様な技術を結集し、開発力・技術提案力を高めます。また、この一元化は、開発加速が必要なエリアへ重点的に人材を投入するなど、開発費とリソースの最適化や、新規製品の投入検討等、エンジニアが能力をいかんなく発揮できる機会の増加につながり、成長を実現することができると考えます。

また、顧客の寡占化が進行するなかで、顧客ごとに営業と技術それぞれの総合窓口を設けました。顧客とのコミュニケーションの密度を上げることで、顧客対応のスピードと精度を高めます。また、コミュニケーションの充実には市場環境変化や真の顧客ニーズへの理解を深めることにつながります。それを当社の開発戦略へ落とし込むことにより、顧客の期待以上のものを提案・提供する「顧客ニーズ創造型企業」を目指します。これらにより、とくに今後大きな市場成長及び当社製品による付加価値の増大が見込まれる分野であるエッチング、成膜、塗布・洗浄事業における、シェアと利益の拡大に努めます。

さらに、IoT時代を迎えると半導体用途が大幅に拡がり、汎用デバイスの需要も飛躍的に拡大すると考えられます。このような環境下においては、当社グループが持つ世界最大の納入済み装置実績は、フィールドソリューション事業の基盤となり、改造、パーツ、認定中古装置などの販売促進につながる事が期待できます。

以上のような事業の成長計画の実現に取り組む一方で、ITシステムを強化し、ヒト・モノ・カネのリソースや、事業進捗の一元管理を進め、あらゆるリソースの重複や無駄を排除します。また、投資と抑制、効率化など、メリハリをつけてコントロールすることで、グロー

バル水準の収益力獲得を目指します。

当社グループは、社員がワクワクして躍動する夢と活力のある会社を目指しています。半導体製造装置及びFPD製造装置事業において、革新的新製品を継続的に創出すべく、成長に向けて新たなチャレンジを続けることができる会社、そして成果が出た際は公正な報酬を得ることができること、これが夢と活力のある会社の姿であると考えています。その実現のための基盤として、国境を問わない流動的な人材活用を実現し、職責と役割に応じた新しい報酬制度を構築します。

③ 資本政策の基本的な方針

上述の経営戦略や経営計画を踏まえ、資本政策の基本方針について、当社グループは以下のように考えております。

資本効率についての考え方

成長投資に必要な資金を確保しつつ、適切なバランスシート・マネジメントに基づき積極的な株主還元を努めてまいります。また、上述の中期経営計画に掲げるファイナンシャルモデルの実現に向け、主として営業利益率、総資産回転率を重視し、ROE（自己資本利益率）の向上を図ります。

株主還元策

- ・当社の配当政策は、業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目処とします。ただし、一株当たりの年間配当金は150円[※]を下回らないこととします。
※2期連続で当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討します。
- ・自己株式の取得については、機動的に実施を検討します。

④ 企業の社会的責任としての取り組み

当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値を創出することが、株主さま及び顧客、取引先、地域社会をはじめとするステークホルダーの皆さまに対する社会的責任であると考え、平成25年に制定したCSR方針のもと、専任組織を中心に重点課題を設定し、進捗のモニタリングを実施しております。

また、当社グループは、平成27年6月に電子産業サプライチェーンの労働・安全・環境・倫理の行動規範を定めるCSRアライアンスであるEICC[®]（Electronic Industry Citizenship Coalition[®]）に加盟しました。EICC[®]加盟にあたり、改めて当社グループ内への同規範の積極的な展開と浸透を目指すとともに、取引先と共同で業界全体のCSRを推進していきます。

加えて、当社グループでは、顧客工場における製品使用時の環境負荷を低減すべく、製品の省エネルギー化に取り組んでいます。平成26年度には今後5年間でエネルギー及び純水の使用量を10%削減するという目標を設定し、削減に努めております。

当社グループは、革新的な技術力と多様なテクノロジーを融合する独創的な提案力で、半導体産業とFPD産業に高い付加価値を生み出してまいります。その結果として顧客から世界ナンバーワンの評価を受け、株主の皆さまや、社員をはじめとする全てのステークホルダーに還元し、産業界に貢献していきたいと考えております。株主の皆さまにおかれましては、一層のご支援とご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

5 財産及び損益の状況の推移

① 当社グループ(連結)の財産及び損益の状況の推移

区 分	第 50 期	第 51 期	第 52 期	第 53 期
	平成24年4月 1 日から 平成25年3月31日まで	平成25年4月 1 日から 平成26年3月31日まで	平成26年4月 1 日から 平成27年3月31日まで	平成27年4月 1 日から 平成28年3月31日まで
売 上 高 (百万円)	497,299	612,170	613,124	663,948
営 業 利 益 (百万円)	12,548	32,204	88,113	116,788
経 常 利 益 (百万円)	16,696	35,487	92,949	119,399
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 (百万円)	6,076	△19,408	71,888	77,891
1株当たり当期純利益 (円)	33.91	△108.31	401.08	461.10
総 資 産 (百万円)	775,527	828,591	876,153	793,367
純 資 産 (百万円)	605,127	590,613	641,162	564,239

- (注) 1. 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
2. △は損失を示しております。
3. 第50期の連結業績は、スマートフォンの普及が本格化し市場の牽引役となったものの、パソコンやテレビの需要が低迷し、半導体製造装置市場、FPD製造装置市場ともに全般的に調整局面が続ぎ、減収減益となりました。
4. 第51期の連結業績は、モバイル端末機器への需要等を背景に、半導体製造装置市場、FPD製造装置市場ともに堅調に推移し増収となりました。しかしながら、太陽光パネル製造装置事業及びTEL NEXX, Inc.の事業計画を見直したことによるのれん等に関する減損損失、並びに拠点再編計画に基づく固定資産の減損等の特別損失計上により、最終損益は赤字となりました。
5. 第52期の連結業績は、新型の高機能スマートフォンの好調な販売、スマートフォンの高性能化に伴う半導体搭載量の増加、またデータセンター向けサーバー需要の伸長などにより、主力の半導体製造装置事業の売上は堅調に推移し、大幅な増益となりました。
6. 第53期の状況につきましては、「1 事業の経過及び成果」に記載のとおりであります。

② 当社(個別)の財産及び損益の状況の推移

区 分	第 50 期	第 51 期	第 52 期	第 53 期
	平成24年4月 1 日から 平成25年3月31日まで	平成25年4月 1 日から 平成26年3月31日まで	平成26年4月 1 日から 平成27年3月31日まで	平成27年4月 1 日から 平成28年3月31日まで
売 上 高 (百万円)	375,485	462,282	555,092	582,623
営 業 利 益 (百万円)	5,717	16,230	47,094	42,092
経 常 利 益 (百万円)	27,314	27,839	86,502	74,861
当 期 純 利 益 (百万円)	22,984	△26,420	63,267	63,549
1株当たり当期純利益 (円)	128.28	△147.44	352.98	376.20
総 資 産 (百万円)	570,042	608,206	671,759	625,968
純 資 産 (百万円)	390,303	356,701	405,468	329,351

(注) △は損失を示しております。

6 重要な子会社の状況（平成28年3月31日現在）

会 社 名	資 本 金	当 社 の 出 資 比 率 (間接出資比率)	主要な事業内容
東京エレクトロン山梨(株)	4,000百万円	100.00%	半導体製造装置・FPD製造装置の製造
東京エレクトロン九州(株)	2,000百万円	100.00%	半導体製造装置・FPD製造装置の製造
東京エレクトロン東北(株)	1,000百万円	100.00%	半導体製造装置の製造
東京エレクトロン宮城(株)	100百万円	100.00%	半導体製造装置の製造
東京エレクトロンFE(株)	100百万円	100.00%	半導体製造装置・FPD製造装置等の保守 サービス・改造・移設
Tokyo Electron America, Inc.	10米ドル	0.00 (100.00)	半導体製造装置等の販売・保守サービス
Tokyo Electron Europe Ltd.	17百万ユーロ	100.00%	半導体製造装置等の販売・保守サービス
Tokyo Electron Korea Ltd.	6,000百万ウォン	100.00%	半導体製造装置・FPD製造装置等の販 売・保守サービス
Tokyo Electron Taiwan Ltd.	200百万NTドル	96.00 (98.00)	半導体製造装置・FPD製造装置等の販 売・保守サービス
Tokyo Electron (Shanghai) Ltd.	6百万米ドル	100.00%	半導体製造装置・FPD製造装置等の販 売・保守サービス

- (注) 1. 当連結会計年度末における連結子会社は、上記各社を含め37社であります。
2. 平成28年2月1日付で、東京エレクトロン山梨(株)は、東京エレクトロンTS(株)を吸収合併いたしました。

7 重要な企業結合等の状況

平成28年2月1日付で、東京エレクトロン山梨(株)は、東京エレクトロンTS(株)を吸収合併いたしました。

8 従業員の状況（平成28年3月31日現在）

① 当社グループの従業員数

セグメントの名称	従業員数	前連結会計年度末比
半導体製造装置	7,967名	90名増
FPD製造装置	466名	2名減
その他	374名	208名減
全社共通	1,822名	95名減
合計	10,629名	215名減

- (注) 1. 従業員数は、当社及び連結子会社の就業人員数を表示しております。
 2. P V製造装置事業につきましては、当連結会計年度から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、報告セグメントから除外し、「その他」の区分に含めて記載する方法に変更しております。前連結会計年度末比については、前連結会計年度の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
 3. その他は、物流、施設管理、保険業務及びP V製造装置事業等にに従事する従業員であり、当該従業員数が減少した主な要因は、平成27年3月26日開催の取締役会で決議いたしましたTEL Solar AGの解散及び清算手続きの実施にともなうものであります。
 4. 全社共通は、管理部門、基礎研究部門等に所属する従業員であります。

② 当社の従業員数

従業員数	前事業年度末比
1,426名	49名減

平均年齢	平均勤続年数
43.3歳	17.0年

(注) 従業員数は、当社の就業人員数を表示しております。

9 主要な借入先（平成28年3月31日現在）

該当事項はありません。

10 主要な事業所（平成28年3月31日現在）

① 当 社

名 称	所 在 地
本社	東京都港区
府中テクノロジーセンター	東京都府中市
大阪支社	大阪府大阪市
山梨事業所（藤井地区） （穂坂地区）	山梨県韮崎市 山梨県韮崎市
札幌事業所	北海道札幌市
九州営業所	熊本県合志市

② 子会社

名 称	所 在 地
東京エレクトロン山梨(株) 山梨事業所（藤井地区） （穂坂地区）	山梨県韮崎市 山梨県韮崎市
東京エレクトロン九州(株) 合志事業所 大津事業所	熊本県合志市 熊本県菊池郡大津町
東京エレクトロン東北(株)	岩手県奥州市
東京エレクトロン宮城(株) 大和事業所 松島事業所	宮城県黒川郡大和町 宮城県宮城郡松島町
東京エレクトロンFE(株)	東京都府中市
Tokyo Electron America, Inc.	米国テキサス州オースチン市
Tokyo Electron Europe Ltd.	英国ウエストサセックス州クローリー
Tokyo Electron Korea Ltd.	韓国京畿道華城市
Tokyo Electron Taiwan Ltd.	台湾新竹市
Tokyo Electron (Shanghai) Ltd.	中国上海市

(注) 平成28年2月1日付で、東京エレクトロン山梨(株)は、東京エレクトロンTS(株)を吸収合併いたしました。

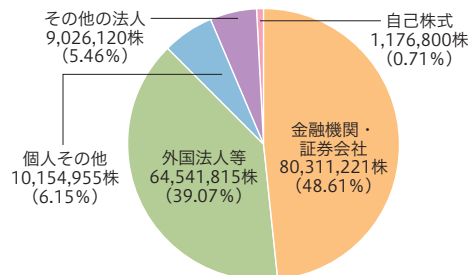
11 その他株式会社の重要な事項

当社とApplied Materials, Inc.は、平成25年9月24日に経営統合の契約を締結し、平成26年6月開催の第51期定時株主総会において、この経営統合の一環として行う当社とTELジャパン合同会社との株式交換についてご承認をいただきました。しかしながら、平成27年6月開催の第52期定時株主総会でご報告のとおり、適用される競争法に基づく関係当局の承認にあたり、米国司法省との間に認識の違いがあり、解決の目処が立たないことが判明したため、平成27年4月27日付(米国時間では平成27年4月26日)で、経営統合契約を解約することについて合意し、経営統合の一環として行われる上記株式交換についても、中止することとなりました。

2. 会社の株式に関する事項 (平成28年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 300,000,000株
 ② 発行済株式の総数 165,210,911株
 (注) 平成28年1月20日付で実施した自己株式の消却により、前事業年度末と比べて15,400,000株減少しております。
 ③ 株主数 24,664名

■所有者別株式分布状況



④ 大株主の状況

株主名	持株数	持株比率
	千株	%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	24,158	14.72
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	17,385	10.59
株式会社東京放送ホールディングス	7,727	4.71
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	4,346	2.64
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	3,583	2.18
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4)	3,282	2.00
B N P パリバ証券株式会社	2,645	1.61
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 5 0 5 2 2 5	2,634	1.60
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 5 0 5 2 3 4	2,450	1.49
ゴールドマン・サックス証券株式会社	2,329	1.42

(注) 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2.持株比率は、自己株式 (1,176,800株) を控除して算出してあります。また、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

3.平成28年2月1日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者である他2社が平成28年1月25日現在、14,461千株所有している旨、平成28年2月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である他2社が平成28年1月29日現在、12,748千株所有している旨、平成28年3月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者である他2社が平成28年2月29日現在、11,145千株所有している旨、平成28年2月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者である他6社が平成28年1月29日現在、10,252千株所有している旨が記載されておりますが、当社として平成28年3月31日現在の実質保有状況の確認ができない部分については、上記表に含めておりません。

⑤ 自己株式に関する重要な事項

ア. 自己株式の取得

平成27年4月27日開催の取締役会における決議により、以下のとおり自己株式を取得いたしました。

取得した株式の種類及び数	当社普通株式15,400,000株
取得価額の総額	105,522,278,669円
取得した期間	平成27年5月14日から平成27年11月19日まで

イ. 自己株式の消却

平成27年12月21日開催の取締役会における決議により、以下のとおり自己株式を消却いたしました。

消却した株式の種類及び数	当社普通株式15,400,000株
消却価額の総額	105,351,178,104円
消却した日	平成28年1月20日

3. 会社の新株予約権等に関する事項

当事業年度末日における新株予約権の状況

区分	割当日	割当個数	当事業年度末日残高			目的となる株式の種類及び数	行使時の払込金額	行使期間	
			うち取締役(社外取締役を除く)の保有状況	うち社外取締役の保有状況	うち監査役の保有状況				
第4回新株予約権	平成17年8月8日	852個	47個	0個(0名)	0個(0名)	0個(0名)	当社普通株式 4,700株	1株当たり 1円	平成20年8月1日から 平成37年6月30日まで (注)1
第6回新株予約権	平成18年6月24日	669個	73個	10個(1名)	0個(0名)	0個(0名)	当社普通株式 7,300株	1株当たり 1円	平成21年7月1日から 平成38年5月29日まで (注)2
第7回新株予約権	平成19年6月23日	1,004個	128個	20個(1名)	0個(0名)	0個(0名)	当社普通株式 12,800株	1株当たり 1円	平成22年7月1日から 平成39年5月31日まで (注)3
第8回新株予約権	平成20年6月21日	1,779個	346個	38個(1名)	0個(0名)	28個(1名)	当社普通株式 34,600株	1株当たり 1円	平成23年7月1日から 平成40年5月31日まで (注)4
第9回新株予約権	平成23年6月18日	2,342個	570個	127個(2名)	0個(0名)	28個(1名)	当社普通株式 57,000株	1株当たり 1円	平成26年7月1日から 平成43年5月30日まで (注)5
第10回新株予約権	平成24年6月23日	1,307個	534個	137個(5名)	0個(0名)	39個(2名)	当社普通株式 53,400株	1株当たり 1円	平成27年7月1日から 平成44年5月31日まで (注)6
第11回新株予約権	平成27年6月20日	1,357個	1,357個	609個(11名)	0個(0名)	47個(1名)	当社普通株式 135,700株	1株当たり 1円	平成30年7月2日から 平成47年5月31日まで (注)7

- (注) 1. 米国での納税者が新株予約権を行使できる期間は平成20年8月1日に限る。
 2. 米国での納税者が新株予約権を行使できる期間は平成21年7月1日に限る。
 3. 米国での納税者が新株予約権を行使できる期間は平成22年7月1日に限る。
 4. 米国での納税者が新株予約権を行使できる期間は平成23年7月1日に限る。
 5. 米国での納税者が新株予約権を行使できる期間は平成26年7月1日に限る。
 6. 米国での納税者が新株予約権を行使できる期間は平成27年7月1日に限る。
 7. 米国での納税者が新株予約権を行使できる期間は平成30年7月2日に限る。

4. 会社役員に関する事項

① 取締役及び監査役の状況（平成28年3月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況等
取締役会	常石哲男	
代表取締役社長	河合利樹	最高経営責任者（CEO） Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. 取締役会長 TEL Venture Capital, Inc. 取締役会長
代表取締役副社長	北山博文	CSR推進担当 Tokyo Electron (Kunshan) Ltd. 取締役会長
取締役	伊東晃	専務執行役員 Tokyo Electron (Shanghai) Ltd. 取締役会長 Tokyo Electron (Shanghai) Logistic Center Ltd. 取締役会長
取締役	鷲野憲治	常務執行役員 Tokyo Electron America, Inc. 取締役会長 Tokyo Electron Europe Ltd. 取締役会長
取締役	堀哲朗	内部統制担当 常務執行役員
取締役	鄭基市	常務執行役員 TEL Technology Center, America, LLC 取締役会長
取締役	鮑本正巳	常務執行役員 東京エレクトロン九州㈱ 代表取締役社長
取締役	佐々木貞夫	常務執行役員 東京エレクトロン東北㈱ 代表取締役社長
取締役	長久保達也	倫理担当 執行役員
取締役相談役	東哲郎	
取締役	井上弘	㈱東京放送ホールディングス 代表取締役会長 ㈱TBSテレビ 代表取締役会長 一般社団法人日本民間放送連盟会長 富士フイルムホールディングス㈱ 社外取締役
取締役	坂根正弘	野村ホールディングス㈱ 社外取締役 野村證券㈱ 社外取締役 旭硝子㈱ 社外取締役 武田薬品工業㈱ 社外取締役 鹿島建設㈱ 社外取締役
常勤監査役	原田芳輝	
常勤監査役	森章次郎	
常勤監査役	赤石幹雄	
監査役	山本高稔	富士重工業㈱ 社外監査役
監査役	酒井竜児	弁護士 小林製薬㈱ 社外監査役

報酬委員会委員：長久保達也、佐々木貞夫、井上弘
指名委員会委員：常石哲男、堀哲朗、鮑本正巳

- (注) 1. 取締役 井上弘氏及び坂根正弘氏は社外取締役であります。
2. 監査役 赤石幹雄氏、山本高稔氏及び酒井竜児氏は社外監査役であります。
3. ㈱東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「社外役員の独立性判断基準」を満たしていることから、当社は、取締役 井上弘氏及び坂根正弘氏並びに監査役 赤石幹雄氏及び山本高稔氏を、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
4. 当社は、取締役 井上弘氏及び坂根正弘氏並びに監査役 原田芳輝氏、森章次郎氏、赤石幹雄氏、山本高稔氏及び酒井竜児氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
5. 監査役 原田芳輝氏は執行役員として当社グループの管理部門を統轄するなど、業務やマネジメントの経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 監査役 森章次郎氏は当社の経理部長及び当社子会社の管理部門を統轄する執行役員を経験するなど、業務やマネジメントの経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
7. 監査役 山本高稔氏は公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
8. 当事業年度中における取締役の地位及び担当の異動は次のとおりであります。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
東哲郎	代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）	取締役相談役	平成28年1月1日
河合利樹	代表取締役副社長 最高執行責任者（COO）	代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）	平成28年1月1日
北山博文	代表取締役副社長 倫理担当 CSR推進担当	代表取締役副社長 CSR推進担当	平成28年1月1日
長久保達也	取締役	取締役 倫理担当	平成28年1月1日

9. 平成28年4月1日をもって、担当及び重要な兼職の状況等が次のとおり変更となりました。

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況等
代表取締役社長	河合利樹	最高経営責任者（CEO） Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. 取締役会長
取締役	鄭基市	常務執行役員 TEL Technology Center, America, LLC 取締役会長 TEL Venture Capital, Inc. 取締役会長 TEL NEXX, Inc. 取締役会長
取締役	井上弘	㈱東京放送ホールディングス 取締役名誉会長 ㈱TBSテレビ 取締役名誉会長 一般社団法人日本民間放送連盟会長 富士フイルムホールディングス㈱ 社外取締役
取締役	坂根正弘	野村ホールディングス㈱ 社外取締役 旭硝子㈱ 社外取締役 武田薬品工業㈱ 社外取締役 鹿島建設㈱ 社外取締役

② 執行役員の状況（平成28年3月31日現在）

会社における地位	氏名	担当
社長	河合利樹	最高経営責任者（CEO） 事業本部長
副社長	北山博文	開発・生産担当副社長
専務執行役員	伊東晃	グローバル・フィールド統括本部長
常務執行役員	鷲野憲治	グローバル・フィールド統括副本部長
常務執行役員	堀哲朗	コーポレート管理本部長 経理・財務・知的財産担当／経営戦略 担当／IR担当／コンプライアンス・内 部統制担当
常務執行役員	佐々木貞夫	開発・生産本部長 コーポレート製品開発担当 製品開発部門担当／成膜担当 東京エレクトロン東北(株) 代表取締役社長
常務執行役員	鄭基市	開発・生産本部副本部長 コーポレート製品開発副担当
常務執行役員	鮑本正巳	開発・生産本部副本部長 塗布・洗浄担当 東京エレクトロン九州(株) 代表取締役社長
常務執行役員	保坂重敏	革新技術企画部門担当
常務執行役員	堤秀介	事業本部副本部長（ES/TPS担当）
常務執行役員	Barry Mayer	グローバル戦略担当 Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. 取締役社長
常務執行役員	David Brough	グローバル戦略担当 欧州リージョン本部長 Tokyo Electron Europe Ltd. 取締役社長
執行役員	長久保達也	コーポレート管理本部副本部長 人事・総務担当／CSR推進担当
執行役員	浜島雅彦	経営戦略担当
執行役員	佐々木健夫	法務・輸出物流管理担当
執行役員	関口章久	先端半導体技術部門担当
執行役員	田原計志	生産部門担当 Tokyo Electron India Private Ltd. 取締役社長
執行役員	小泉恵資	IT本部長
執行役員	七澤豊	IT本部副本部長 TEL Solar Services AG 取締役社長
執行役員	池田世崇	CT BUGM
執行役員	三田野好伸	ES BUGM

会社における地位	氏名	担当
執行役員	多田新吾	TPS BUGM
執行役員	大久保豪	SD BUGM
執行役員	西垣寿彦	SPS BUGM TEL FSI, Inc. 取締役社長
執行役員	阿部祐一	ATS BUGM
執行役員	春原清	FS BUGM
執行役員	松浦次彦	FPD BUGM
執行役員	笹原信一	PVE担当
執行役員	堀井義明	リージョン戦略企画本部長
執行役員	田原好文	製品開発部門副担当／成膜副担当 東京エレクトロン山梨(株) 代表取締役社長
執行役員	伊藤博道	東京エレクトロン宮城(株) 代表取締役社長

(注) 1. 表中に使用しております用語の説明は、次のとおりであります。

ES : エッチングシステム
 TPS : サーマルプロセスシステム
 CT : クリーンラック
 SD : 枚葉成膜
 SPS : サーフェスプレパレーションシステム
 ATS : アッセンブルアンドテストシステム
 FS : フィールドソリューション
 FPD : フラットパネルディスプレイ
 PVE : 太陽光パネル製造装置
 BU : ビジネスユニット
 GM : ジェネラルマネージャー

2. 平成28年4月1日をもって保坂重敏氏が常務執行役員を、笹原信一氏が執行役員を退任いたしました。また、同日付で担当が変更され次のとおりとなりました。

会社における地位	氏名	担当
常務執行役員	鄭基市	開発・生産本部副本部長 コーポレート製品開発副担当 革新技術企画部門担当

③ 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	固定報酬 (月額報酬)	業績連動報酬(年次)	
	当事業 年 度 支 払 額	賞与 (注) 1	株式報酬型 ストック オプション (注) 2
取締役報酬総額 (14名)	百万円 604	百万円 637	百万円 1,050
うち社外取締役報酬総額 (2名)	24	16	
監査役報酬総額 (5名)	118		
うち社外監査役報酬総額 (常勤監査役1名を含む3名)	54		

(ご参考) 当事業年度に係る当社代表取締役の個別報酬等

会社における 地位及び氏名	固定報酬 (月額報酬)	業績連動報酬(年次)	
	当事業 年 度 支 払 額	賞与 (注) 1	株式報酬型 ストック オプション (注) 2
代表取締役 社 長 河合利樹 (注) 7	百万円 58	百万円 69	百万円 86
代表取締役 副 社 長 北山博文	72	72	132

- (注) 1. 平成28年6月17日開催予定の第53期定時株主総会において付議いたします取締役賞与額を記載しております。
2. 株式報酬型ストックオプションに関しましては、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号)に従い、当事業年度に費用計上した額を記載しております。なお、費用計上につきましては、付与日から権利確定日までの対象勤務期間にて按分しておりますが、平成27年に付与した第11回新株予約権から対象勤務期間を見直したことに伴い、第11回新株予約権分につきましては当事業年度に全額を費用計上し、また、平成28年6月17日開催予定の第53期定時株主総会において付議いたします新株予約権に相当する部分については、業績連動報酬の算定基礎となる当事業年度に全額を費用計上しております。これにより、平成24年に付与した第10回分の7百万円、平成27年に付与した第11回分の453百万円、及び平成28年6月17日開催予定の第53期定時株主総会において付議いたします新株予約権に相当する589百万円が計上されております。
3. 取締役の固定報酬限度額は、平成23年6月17日開催の第48期定時株主総会において1事業年度につき7億5千万円以内(うち社外取締役分、1事業年度につき3千万円以内)と決議されております。なお、執行役員兼務取締役に対し、取締役報酬のほかに使用人分給与を支給していません。
4. 監査役の報酬限度額は、平成23年6月17日開催の第48期定時株主総会において月額1千3百万円以内(年額1億5千6百万円以内)と決議されております。
5. 監査役原田芳輝氏は、平成27年6月19日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した後、監査役に就任したため、報酬等の額につきましては、取締役在任期間は取締役報酬総額に、監査役在任期間は監査役報酬総額にそれぞれ区分して記載しております。
6. 代表取締役の個別報酬等の額につきましては、取締役会のなかに報酬委員会を設置し、代表取締役の報酬を取締役に提案することとしております。
7. 取締役に就任した平成27年6月19日以降の報酬を記載しております。

④ 会社役員の報酬等の額の算定方法に係る決定に関する方針

ア. 報酬方針

当社は、世界レベルでの企業競争力強化及び経営の透明性向上を意図し、業績や株主価値との高い連動性を持つ役員報酬制度を採用します。取締役及び執行役員の報酬は、月額固定報酬と年次業績連動報酬で構成しています。また監査役については、経営に対する独立性に鑑み、月額固定報酬のみとします。なお、固定報酬的色彩の強い取締役・監査役に対する役員退職慰労金制度につきましては、第43期（平成18年3月期）以降分を廃止しました。

イ. 報酬委員会の役割

社外取締役を含む3名以上の取締役で構成される報酬委員会は、業界の国内外企業との報酬水準の分析比較を行った上で、金額のみならず他の種々の報酬環境の分析も踏まえ、取締役会に対し役員報酬の方針・制度及び代表取締役・CEOの賞与を含む個別報酬額について提案を行います。

ウ. 報酬算定方式

CEOを含む取締役の業績連動報酬制度につきましては、企業価値・株主価値向上に対する要素をより明確に報酬に連動させるため、親会社株主に帰属する当期純利益と連結ROE（連結自己資本利益率）の当期実績値を主たる算定指標とし、特殊な損益及び考慮すべき特殊要因等がある場合は必要な調整を行います。

業績連動報酬は原則として現金賞与と株式報酬で構成し、その取締役における構成割合は概ね1対1としており、年次の業績はCEOを含む取締役の業績連動報酬に適切に反映します。なお、業績連動報酬額は年間固定報酬額の5倍の金額を上限とします。株式報酬につきましては、「権利行使価額を1株につき1円に設定した新株予約権」を付与し、3年間の権利行使制限期間を設定しております。

また、中長期業績との連動性をより高めた報酬制度の導入について、今後報酬委員会を中心に検討する予定です。

⑤ 社外役員に関する事項

ア.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係（平成28年3月31日現在）

区分	氏名	重要な兼職の状況	当社との関係
社外取締役	井上 弘	(株)東京放送ホールディングス 代表取締役会長 (株)TBSテレビ 代表取締役会長 一般社団法人日本民間放送連盟会長 富士フイルムホールディングス(株) 社外取締役	重要な取引関係はありません。
社外取締役	坂根正弘	野村ホールディングス(株) 社外取締役 野村證券(株) 社外取締役 旭硝子(株) 社外取締役 武田薬品工業(株) 社外取締役 鹿島建設(株) 社外取締役	重要な取引関係はありません。
社外監査役	山本高稔	富士重工業(株) 社外監査役	重要な取引関係はありません。
社外監査役	酒井竜児	小林製薬(株) 社外監査役	重要な取引関係はありません。

イ.当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況
社外取締役	井上 弘	当事業年度開催の取締役会14回の全てに出席し、企業経営者としての豊富な経験・見識を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
社外取締役	坂根正弘	当事業年度開催の取締役会14回の全てに出席し、企業経営者としての豊富な経験・見識を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役	赤石幹雄	当事業年度開催の取締役会14回の全て及び当事業年度開催の監査役会9回の全てに出席し、他企業での監査役等の経験・見識を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役	山本高稔	当事業年度開催の取締役会14回の全て及び当事業年度開催の監査役会9回の全てに出席し、エレクトロニクス業界を担当する証券アナリストとしての経験・見識を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役	酒井竜児	当事業年度開催の取締役会14回のうち13回及び当事業年度開催の監査役会9回の全てに出席し、弁護士としての専門的見地から、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

5. 会計監査人の状況

1 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

2 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	区 分	支払額
①	当社が支払うべき公認会計士法第2条第1項の監査業務についての報酬等の額	157百万円
②	当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額	188百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額等を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社は、会計監査人に対し、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、財務報告に係る内部統制整備業務についての対価100万円を支払っております。
3. 当社の重要な子会社のうち、次の各社は当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監査を受けております。
 Tokyo Electron America, Inc.
 Tokyo Electron Europe Ltd.
 Tokyo Electron Korea Ltd.
 Tokyo Electron Taiwan Ltd.
 Tokyo Electron (Shanghai) Ltd.

3 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

4 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。

6. 会社の体制及び方針

1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制についての決議内容

当社が、業務の適正を確保するための体制の基本方針として取締役会において決議した内容は、次のとおりであります。

内部統制基本方針

I 取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社グループの取締役及び従業員には、法令・定款を遵守するとともに高い倫理観をもって行動することが求められる。
- ② 当社グループの取締役及び従業員は、『東京エレクトロングループ倫理基準』及び『コンプライアンス規程』をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を従業員の行動規範とし、これを実践しなければならない。
- ③ 企業倫理の徹底を図るため任命する倫理担当取締役は、倫理委員会及び法令遵守の取り組みに関する活動を定期的に取締役会に報告するものとする。
- ④ 代表取締役社長の直轄組織として設置する内部監査部門は、業務執行状況の内部監査を行う。この内部監査には、コンプライアンス違反の有無の監査も含まれるものとする。
- ⑤ 監査役は、取締役の職務執行の監査を行うにあたり、取締役の法令・定款に違反する行為があったとき、又はするおそれがあると認められた時は、取締役に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じる。
- ⑥ 法令上疑義のある行為などについて、従業員が直接情報提供を行う手段として設置した内部通報制度（ホットライン）の維持・運営を図る。この場合、通報者の希望により匿名性を保証するとともに、不利益のないことを確保する。
- ⑦ 当社グループの財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況の有効性評価を定期的に行う。
- ⑧ 市民社会の秩序・安全ならびに企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力とは一切関係を持たないこととし、不当な要求等に対しては断固としてこれを拒絶する。

II 取締役の職務の執行に係る情報の保存、管理及び報告に関する体制

- ① 『文書管理規程』に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
- ② 取締役の職務執行に係るこれらの文書等が速やかに閲覧できる状態を維持するものとする。
- ③ 『関係会社管理規程』に従い、グループ会社の業績・財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。

III 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 『リスク管理規程』において管理すべきリスクの種類の特定及びリスク管理体制の明確化を図る。
- ② 同規程においてリスク毎の責任部署を定め、グループ全体のリスクを管理し、リスク管理体制を明確化し、適正な運営を図る。
- ③ 地震等のリスクにおける事業の継続を確保するための態勢整備を継続推進する。
- ④ 重要リスクに關しては、状況及び対応策を業務担当取締役が定期的に取締役会に報告する。

IV 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項などグループ経営の重要事項を決定する

- とともに、当社グループ全体の業務執行状況を監督する。
- ② 取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、社外（独立）取締役の招聘に取り組むものとする。
 - ③ 取締役会は、取締役会決議によって、代表取締役・業務執行取締役及び執行役員に所管業務の執行を行わせる。
 - ④ 当社は『取締役会規程』、『職務権限規程』、『決裁基準に関する規程』により、権限及び意思決定に関する基準を定め、グループ会社にこれらに準拠した体制を構築させる。

V 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社グループの企業集団としての業務の適正と有効性を確保するために必要となる、グループ全体に適用すべき規程類を整備する。
- ② 監査役は、当社グループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう当社グループ会社の監査役との連携体制を構築する。
- ③ 内部監査部門は、企業集団の業務における適正性の確保状況についての監査を行う。

VI 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性及び実効性に関する事項

- ① 監査役が、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役付使用人を配置する。
- ② 監査役付使用人は、監査役の指示に従いその職務を行い、他部署の使用人を兼務する場合にも、監査役職務の補助業務を優先する。
- ③ 前項の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任免、異動、人事考課等人事に係る事項に関しては、常勤監査役の同意を必要とする。

VII 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

- ① 当社グループの取締役、監査役及び従業員は、法令に違反する事実及び当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項を発見したときは、当社監査役に対して速やかに報告しなければならない。また、当社グループは当社監査役への報告者に対して不利益のないことを確保する。
- ② 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの取締役、監査役及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
- ③ 各監査役は、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行う他、必要に応じて、取締役及び担当執行役員その他各部門に対して、報告を求めることができる。
- ④ 監査役会は、内部監査部門から内部監査結果についての報告を受けるものとする。

VIII その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 内部統制を有効に構築する目的で、監査役と代表取締役との定期的意見交換の場を設けるものとする。
- ② 監査役会は、内部統制を有効に構築する目的で、会計監査人及び内部監査部門との情報共有を行う。
- ③ 監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外（独立）監査役の招聘に取り組むとともに、常勤監査役を置く。
- ④ 監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用で法律・会計等の専門家を活用することができる。
- ⑤ 監査役がその職務の執行について生ずる費用等を請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要な場合を除き、当社はこれを負担する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

1. コンプライアンス体制

- ① 『東京エレクトロングループ倫理基準』及び『コンプライアンス規程』に基づき、コンプライアンスの重要性について周知・徹底を図っております。
- ② コンプライアンス関連教育につきましては、テーマに応じて階層別、または全員必修としており、企業倫理・コンプライアンス、輸出コンプライアンス、インサイダー取引防止、下請法等のテーマを取りあげております。
- ③ 法令や企業倫理上疑義のある行為については、従業員が直接情報提供を行う手段として、倫理ホットラインとコンプライアンスホットラインを設置するとともに、海外拠点においては拠点ごとの通報窓口も設置しております。

2. リスク管理体制

- ① 『リスク管理規程』及び『クライシスマネジメント規程』を制定し、当社グループを取り巻くリスクの評価・分析を行い、重要なリスクについては必要な施策を推進するとともに、リスク管理活動の状況を定期的に取り締役会及び監査役に報告し、リスク低減に努めております。
- ② 当社グループでは、地震等のリスクに対応した事業継続計画を構築しておりますが、各拠点における早期復旧、代替生産等に向けた対策の見直しに取り組んでおります。

3. グループ会社の経営管理

- ① グループ会社の重要な意思決定につきましては、当社『取締役会規程』及び『決裁基準に関する規程』に基づき、当社の承認を得ることとしております。
- ② 『関係会社管理規程』に基づき、事業計画に沿って業務を遂行した結果について、子会社から月次報告を受けております。

4. 取締役の職務執行

取締役会はグループ経営の重要事項を決定するとともに当社グループ全体の業務執行状況を監督しております。また、取締役会は、代表取締役・業務執行取締役及び執行役員を選任し、所管業務の執行を行わせております。

5. 監査役の監査体制

- ① 監査役は、取締役会のほか、経営会議、倫理委員会等の重要会議にも適宜出席し、内部統制の整備、運用状況を確認しております。
- ② 監査役は、会計監査人及び国内子会社監査役と適宜会合を持ち、情報交換及び連携を行っております。また、当社監査役及び国内子会社監査役は内部監査部門（監査センター）から定期的に報告を受けております。

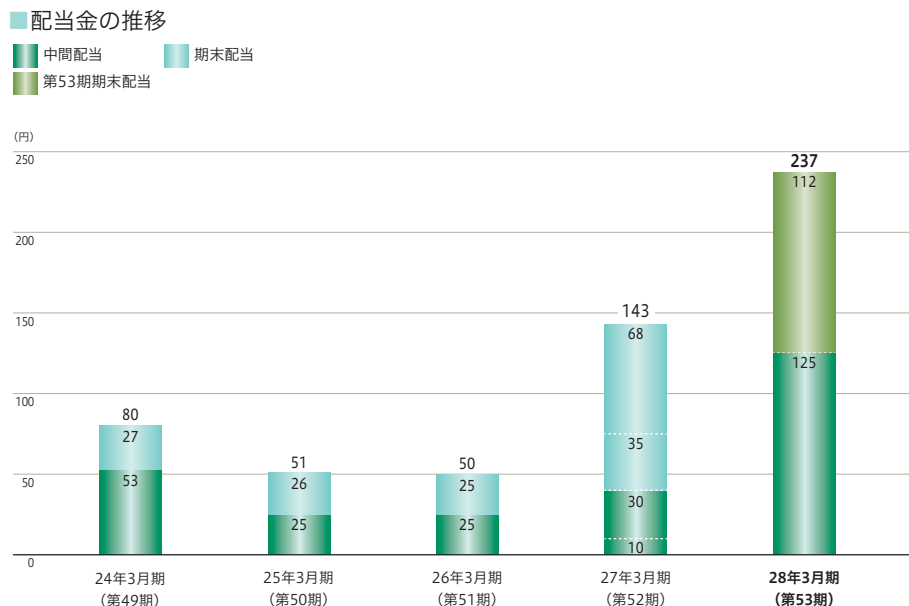
2 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、利益成長を通じて企業価値向上を図るべく、内部留保資金を有効活用し、成長分野に重点的に投資するとともに、業績連動型配当により、株主各位に対して直接還元してまいりました。将来の成長の礎となる高付加価値事業における研究開発・設備・人材への投資を、積極的に実施する方針に変更はありませんが、より魅力的な株主還元策として、平成27年7月10日開催の取締役会において、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向を35%から50%へ引き上げ、株主還元の基本方針を以下のとおり変更いたしました。

株主還元策

- ・当社の配当政策は業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目処とします。ただし、一株当たりの年間配当金は150円^{*}を下回らないこととします。
^{*}2期連続で当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討します。
- ・自己株式の取得については、機動的に実施を検討します。

第53期期末配当につきましては、下半期の連結業績に上記新方針を適用し、1株当たり112円とさせていただきます、支払開始日を平成28年5月27日といたしました。これにより、年間配当金は、中間配当金（1株当たり125円）を含め1株当たり237円となります。



- (注) 1. 平成28年3月期中間配当から、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向の目処を35%から50%に変更しております。
 2. 第52期の1株当たりの配当金143円の内訳は、第1四半期10円、第2四半期30円、第3四半期35円、第4四半期68円となります。

連結計算書類

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	期別	第53期 (平成28年3月31日現在)	第52期(ご参考) (平成27年3月31日現在)	増減(ご参考)	科目	期別	第53期 (平成28年3月31日現在)	第52期(ご参考) (平成27年3月31日現在)	増減(ご参考)
資産の部					負債の部				
流動資産		617,416	670,882	△ 53,466	流動負債		166,060	172,812	△ 6,751
現金及び預金		75,674	79,382		支払手形及び買掛金		55,050	56,478	
受取手形及び売掛金		116,503	110,845		未払法人税等		22,460	6,196	
有価証券		160,999	238,532		賞与引当金		11,623	12,111	
商品及び製品		130,478	112,301		製品保証引当金		8,686	10,441	
仕掛品		41,556	41,483		その他		68,239	87,583	
原材料及び貯蔵品		23,044	21,803		固定負債		63,067	62,178	889
繰延税金資産		31,203	27,671		退職給付に係る負債		55,302	51,104	
その他		38,003	39,241		その他		7,765	11,074	
貸倒引当金	△	48	378		負債合計		229,128	234,991	△ 5,862
固定資産		175,951	205,271	△ 29,319	純資産の部				
有形固定資産		96,316	106,896	△ 10,579	株主資本		552,551	612,736	△ 60,184
建物及び構築物		47,859	55,068		資本金		54,961	54,961	
機械装置及び運搬具		16,803	19,874		資本剰余金		78,023	78,023	
土地		23,867	25,021		利益剰余金		427,618	488,816	
その他		7,786	6,931		自己株式	△	8,050	△ 9,064	
無形固定資産		17,603	27,566	△ 9,963	その他の包括利益累計額		9,817	26,747	△ 16,929
その他		17,603	27,566		その他有価証券評価差額金		7,902	9,463	
投資その他の資産		62,031	70,807	△ 8,775	繰延ヘッジ損益		50	122	
投資有価証券		19,914	23,934		為替換算調整勘定		6,742	12,481	
繰延税金資産		20,781	18,347		退職給付に係る調整累計額	△	4,877	4,681	
退職給付に係る資産		1,623	8,817		新株予約権		1,641	1,420	220
その他		21,537	21,591		非支配株主持分		228	257	△ 29
貸倒引当金	△	1,825	1,884		純資産合計		564,239	641,162	△ 76,923
資産合計		793,367	876,153	△ 82,785	負債純資産合計		793,367	876,153	△ 82,785

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	期別	第53期 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)	第52期(ご参考) (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)	増減(ご参考)
売上高		663,948	613,124	50,823
売上原価		396,738	370,351	
売上総利益		267,209	242,773	24,436
販売費及び一般管理費		150,420	154,660	
営業利益		116,788	88,113	28,675
営業外収益		3,798	4,985	△ 1,187
受取利息		547	901	
為替差益		886	1,575	
補助金収入		400	629	
その他		1,964	1,880	
営業外費用		1,187	149	1,037
自己株式取得費用		662	—	
閉鎖拠点維持管理費用		147	47	
その他		378	102	
経常利益		119,399	92,949	26,450
特別利益		1,470	1,894	△ 423
固定資産売却益		1,025	1,839	
投資有価証券売却益		445	54	
特別損失		14,403	8,015	6,387
減損損失		9,727	2,505	
事業再編損失		2,235	—	
関係会社整理損		—	1,069	
拠点再編費用		—	1,046	
関税追加徴収額		—	1,003	
その他		2,441	2,390	
税金等調整前当期純利益		106,466	86,827	19,638
法人税、住民税及び事業税		32,559	14,726	
法人税等調整額		△ 4,029	172	
法人税等合計		28,530	14,898	13,631
当期純利益		77,936	71,928	6,007
非支配株主に帰属する当期純利益		44	40	
親会社株主に帰属する当期純利益		77,891	71,888	6,003

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

特集

連結株主資本等変動計算書 第53期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位:百万円）

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当連結会計年度期首残高	54,961	78,023	488,816	△ 9,064	612,736
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△ 33,013		△ 33,013
親会社株主に帰属する当期純利益			77,891		77,891
自己株式の取得				△ 105,809	△ 105,809
自己株式の処分			△ 725	1,472	746
自己株式の消却			△ 105,351	105,351	—
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	△ 61,198	1,013	△ 60,184
当連結会計年度末残高	54,961	78,023	427,618	△ 8,050	552,551

	その他の包括利益累計額					新株予約権	非支配株主分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計			
当連結会計年度期首残高	9,463	122	12,481	4,681	26,747	1,420	257	641,162
連結会計年度中の変動額								
剰余金の配当								△ 33,013
親会社株主に帰属する当期純利益								77,891
自己株式の取得								△ 105,809
自己株式の処分								746
自己株式の消却								—
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）	△ 1,560	△ 71	△ 5,738	△ 9,559	△ 16,929	220	△ 29	△ 16,738
連結会計年度中の変動額合計	△ 1,560	△ 71	△ 5,738	△ 9,559	△ 16,929	220	△ 29	△ 76,923
当連結会計年度末残高	7,902	50	6,742	△ 4,877	9,817	1,641	228	564,239

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(ご参考) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	期別	増減		
		第53期 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)	第52期 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)	
税金等調整前当期純利益		106,466	86,827	
減価償却費		19,257	20,878	
減損損失		9,727	2,505	
のれん償却額		970	1,150	
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△	1,685	259	
受取利息及び受取配当金	△	855	1,280	
固定資産売却損益 (△は益)	△	899	1,820	
関係会社株式売却損益 (△は益)		1,110	1,609	
売上債権の増減額 (△は増加)	△	8,649	1,318	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	23,535	26,849	
仕入債務の増減額 (△は減少)		31	9,432	
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△	1,910	11,383	
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△	1,022	2,706	
前受金の増減額 (△は減少)	△	15,003	12,911	
その他	△	202	1,203	
小計		83,797	94,424	△ 10,626
利息及び配当金の受取額		956	1,621	
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△	15,356	24,239	
営業活動によるキャッシュ・フロー		69,398	71,806	△ 2,408
定期預金の預入による支出	△	25,000	—	
定期預金の払戻による収入		12	5	
短期投資の取得による支出	△	184,490	24,996	
短期投資の償還による収入		68,492	188,296	
有形固定資産の取得による支出	△	11,294	11,898	
有形固定資産の売却による収入		2,150	2,548	
無形固定資産の取得による支出	△	707	422	
投資有価証券の売却による収入		1,330	1,093	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		—	1,726	
その他	△	506	615	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	150,013	155,737	△ 305,751
自己株式の取得による支出	△	105,532	183	
配当金の支払額	△	33,013	17,923	
その他	△	55	106	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	138,600	18,213	△ 120,387
現金及び現金同等物に係る換算差額	△	2,776	3,505	△ 6,282
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△	221,993	212,835	△ 434,828
現金及び現金同等物の期首残高		317,632	104,797	212,835
現金及び現金同等物の期末残高		95,638	317,632	△ 221,993
「現金及び現金同等物の期末残高」並びに短期投資等 合計額(注2)		236,673	317,682	△ 81,009

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資を加えた残高を示しております。

計算書類

(個別) 貸借対照表

(単位:百万円)

科目	期別	第53期 (平成28年3月31日現在)	第52期(ご参考) (平成27年3月31日現在)	増減(ご参考)	科目	期別	第53期 (平成28年3月31日現在)	第52期(ご参考) (平成27年3月31日現在)	増減(ご参考)
資産の部					負債の部				
流動資産		488,804	520,586	△ 31,782	流動負債		279,994	249,322	30,671
現金及び預金		29,085	18,170		買掛金		116,019	98,806	
受取手形		81	22		リース債務		1	1	
売掛金		112,044	103,577		未払金		23,531	24,181	
有価証券		160,999	237,731		未払費用		2,031	2,662	
商品		123,464	89,507		未払法人税等		16,243	—	
貯蔵品		116	162		前受金		30,306	28,307	
前払費用		1,186	1,279		預り金		88,008	91,891	
繰延税金資産		11,269	8,657		賞与引当金		2,506	2,638	
その他		50,558	61,771		役員賞与引当金		1,315	768	
貸倒引当金	△	1	293		その他		28	64	
固定資産		137,164	151,172	△ 14,008	固定負債		16,622	16,967	△ 344
有形固定資産		28,680	30,535	△ 1,855	リース債務		1	2	
建物		5,872	6,108		退職給付引当金		16,246	16,567	
構築物		167	198		役員退職慰労引当金		374	374	
機械及び装置		1,094	1,894		その他		1	23	
車両運搬具		25	8		負債合計		296,616	266,290	30,326
工具、器具及び備品		1,110	1,013		純資産の部				
土地		20,407	21,307		株主資本		320,141	394,667	△ 74,526
リース資産		2	4		資本金		54,961	54,961	
無形固定資産		1,629	1,846	△ 217	資本剰余金		78,023	78,023	
特許権		801	890		資本準備金		78,023	78,023	
ソフトウェア		746	817		利益剰余金		195,207	270,747	
その他		81	139		利益準備金		5,660	5,660	
投資その他の資産		106,853	118,790	△ 11,936	その他利益剰余金		189,547	265,087	
投資有価証券		16,882	20,746		特別償却準備金		228	318	
関係会社株式		25,981	26,330		別途積立金		—	190,000	
関係会社出資金		—	1		繰越利益剰余金		189,319	74,768	
長期貸付金		213	—		自己株式	△	8,050	9,064	
従業員に対する長期貸付金		3	3		評価・換算差額等		7,568	9,380	△ 1,811
関係会社長期貸付金		51,508	59,366		その他有価証券評価差額金		7,545	9,245	
破産更生債権等		448	452		繰延ヘッジ損益		22	134	
長期前払費用		1,220	1,330		新株予約権		1,641	1,420	220
前払年金費用		1,750	1,130		純資産合計		329,351	405,468	△ 76,117
繰延税金資産		2,375	2,855		負債純資産合計		625,968	671,759	△ 45,790
その他		6,972	7,110						
貸倒引当金	△	502	536						
資産合計		625,968	671,759	△ 45,790					

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(個別) 損益計算書

(単位:百万円)

科目	期別	第53期 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)	第52期(ご参考) (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)	増減(ご参考)
売上高		582,623	555,092	27,530
売上原価		495,804	451,457	
売上総利益		86,819	103,635	△ 16,815
販売費及び一般管理費		44,726	56,541	
営業利益		42,092	47,094	△ 5,001
営業外収益		35,379	40,101	△ 4,721
受取配当金		33,351	33,808	
その他		2,027	6,292	
営業外費用		2,611	693	1,917
支払利息		439	406	
為替差損		570	—	
自己株式取得費用		662	—	
外国源泉税		463	—	
その他		475	286	
経常利益		74,861	86,502	△ 11,640
特別利益		4,440	2,157	2,282
固定資産売却益		991	119	
投資有価証券売却益		445	54	
関係会社支援損戻入額		3,003	—	
関係会社株式売却益		—	1,983	
特別損失		705	26,757	△ 26,052
固定資産除売却損		85	87	
投資有価証券売却損		246	—	
関係会社株式評価損		347	4,312	
関係会社支援損		—	12,311	
関係会社貸付金貸倒損失		—	8,230	
その他		25	1,816	
税引前当期純利益		78,596	61,902	16,694
法人税、住民税及び事業税		16,033	△ 2,651	
法人税等調整額		△ 986	1,286	
法人税等合計		15,046	△ 1,364	16,411
当期純利益		63,549	63,267	282

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

特集

(個別) 株主資本等変動計算書

第53期 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:百万円)

	株 主 資 本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
				特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当事業年度期首残高	54,961	78,023	5,660	318	190,000	74,768	270,747	△ 9,064	394,667
事業年度中の変動額									
特別償却準備金の積立				10		△ 10	—		—
特別償却準備金の取崩				△ 100		100	—		—
別途積立金の取崩					△ 190,000	190,000	—		—
剰余金の配当						△ 33,013	△ 33,013		△ 33,013
当期純利益						63,549	63,549		63,549
自己株式の取得								△ 105,809	△ 105,809
自己株式の処分						△ 725	△ 725	1,472	746
自己株式の消却						△ 105,351	△ 105,351	105,351	—
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)									
事業年度中の変動額合計	—	—	—	△ 90	△ 190,000	114,550	△ 75,539	1,013	△ 74,526
当事業年度末残高	54,961	78,023	5,660	228	—	189,319	195,207	△ 8,050	320,141

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計		
当事業年度期首残高	9,245	134	9,380	1,420	405,468
事業年度中の変動額					
特別償却準備金の積立					—
特別償却準備金の取崩					—
別途積立金の取崩					—
剰余金の配当					△ 33,013
当期純利益					63,549
自己株式の取得					△ 105,809
自己株式の処分					746
自己株式の消却					—
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△ 1,699	△ 111	△ 1,811	220	△ 1,590
事業年度中の変動額合計	△ 1,699	△ 111	△ 1,811	220	△ 76,117
当事業年度末残高	7,545	22	7,568	1,641	329,351

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年5月11日

東京エレクトロン株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 山田 治彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 松本 尚己 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、東京エレクトロン株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京エレクトロン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

独立監査人の監査報告書

平成28年5月11日

東京エレクトロン株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 山田 治彦 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 松本 尚己 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、東京エレクトロン株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第53期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査報告書

当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第53期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等及び監査役との情報交換を図り、必要に応じて子会社から、事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、財務報告に係る内部統制については、この他、有限責任あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
 - ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
 - ③ 内部統制システムに関する取締役会決議（財務報告に係る内部統制を含む。）の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年5月11日

東京エレクトロン株式会社 監査役会

常勤監査役 原 田 芳 輝 ㊟
 常勤監査役 森 章次郎 ㊟
 常勤監査役 赤 石 幹 雄 ㊟
 監 査 役 山 本 高 稔 ㊟
 監 査 役 酒 井 竜 児 ㊟

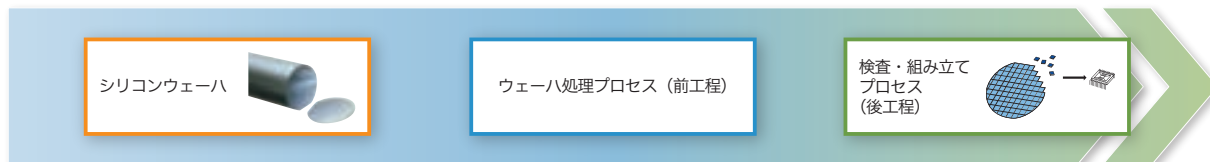
(注)監査役 赤石幹雄及び監査役 山本高稔及び監査役 酒井竜児は会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上

特集 半導体 (IC) / TFT-LCD製造プロセス

半導体 (IC) 製造プロセス

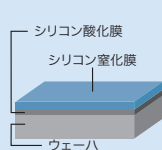
半導体は、シリコンウェーハ上に金属や絶縁体の薄膜を重ねあわせ、回路を形成したものです。半導体の製造プロセスは、回路を形成する前工程と組立・パッケージング・検査を行う後工程の二つに分かれます。



ウェーハ処理プロセス (前工程)

当社グループの提供する装置の多くが前工程で使用されており、世界で高い評価を獲得しています。

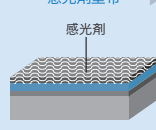
酸化膜形成、窒化膜形成



シリコン酸化膜を化学的に成長させた後、シリコン窒化膜を堆積させる

熱処理成膜装置

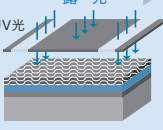
感光剤塗布



感光剤をウェーハ全面に薄く均一に塗布する

コータ/デベロッパ
レジスト塗布現像装置

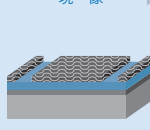
露光



UV光を当て、感光剤上にIC回路を転写する

パターン形成

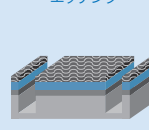
現像



IC回路パターンをウェーハ上に作り出す

コータ/デベロッパ
レジスト塗布現像装置

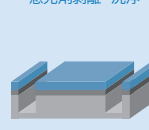
エッチング



ウェーハ上のパターンに従って、対象膜を化学反応により加工・除去する

プラズマエッチング装置

感光剤剥離・洗浄



エッチング後の感光剤を除去した後、薬液に浸し、不純物を除去する

洗浄装置

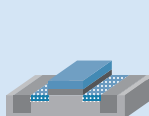
素子分離形成



酸化膜を堆積させ、ウェーハ上に形成した溝に埋め込む。膜の表面を研磨し、平坦にする

枚葉CVD^{※1}装置

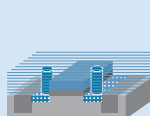
電極形成



不純物注入後に均一に拡散させ、トランジスタの電極を形成する

ALD^{※2}装置

配線用ホール形成



酸化膜を堆積させ表面を平坦にする。配線用ホールを開口し、金属膜を埋め込む

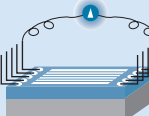
枚葉CVD装置

多層配線形成



多層配線間絶縁膜を形成し、配線溝パターンを作り個々のトランジスタを接続する

ウェーハ検査



でき上がったIC回路を検査する

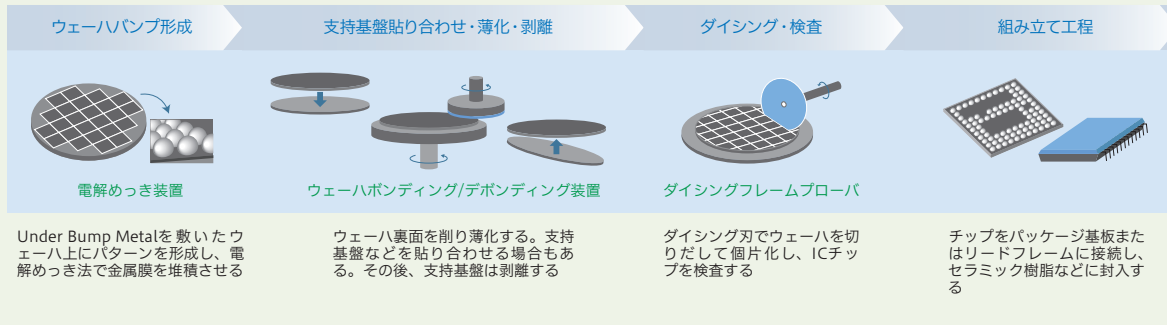
ウェーハプローバ

※1 CVD : Chemical Vapor Deposition (化学気相成長)

※2 ALD : Atomic Layer Deposition (原子層堆積)

検査・組み立てプロセス（後工程）

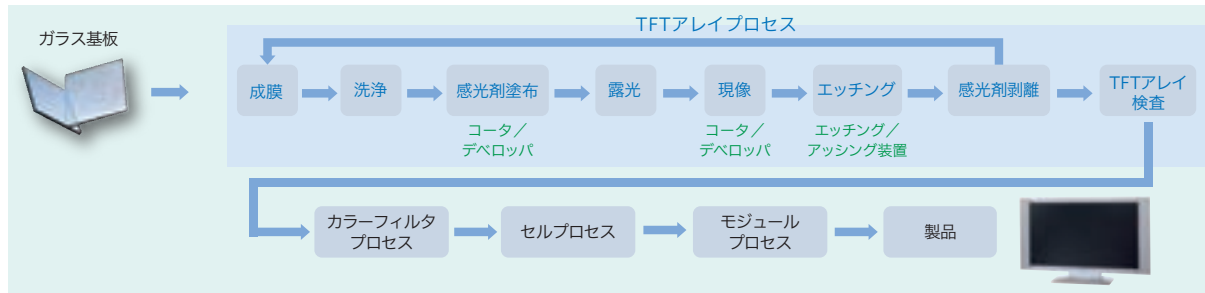
近年、半導体の微細化により後工程の重要性が増しており、当社グループでは当分野を強化し、装置ラインナップを拡充させています。



TFT-LCD製造プロセス

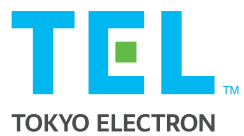
FPD製造の要となるTFTアレイプロセスは、半導体製造におけるウェーハ処理プロセスとほぼ同様の工程です。

※TFT…Thin Film Transistor（薄膜トランジスタ）



株主メモ

事業年度	4月1日から翌年の3月31日まで
定時株主総会	事業年度終了後3ヵ月以内
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主確定日	期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
(郵便物送付先) (電話照会先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 ☎ 0120-782-031 (フリーダイヤル)
単元未満株式の 買取請求取扱	お取引証券会社等 (特別口座で管理されている場合は特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社)
公告方法	電子公告 (電子公告アドレス (http://www.tel.co.jp/ir/stocks/koukoku/) ただし、電子公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。
上場金融商品取引所	東京証券取引所 市場第一部 (証券コード 8035)



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。